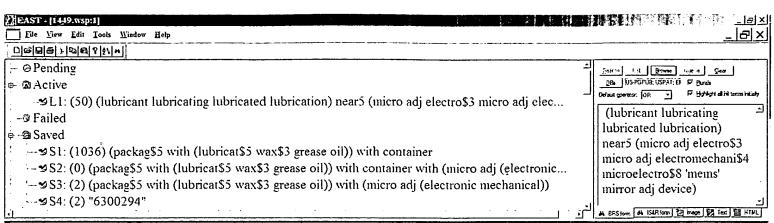


	U	T	1 Do	cument I	Issue Dat	Page	Title	Current O	Current X Ret	rieval	Inventor	s	C	P	2	3 P
11	Þ	1	- ¡US	2004014	2004080	15	Method of preparing free	:204/296		S	Schlenoff, Joseph B	Γ.	г	г	7	ר'ר
12	₽	֚֚֚֚֚֚֚֚֚֝֟֝֞֟֝֟֝֟֝֟֝֝֟֝֟֝֟֝֟֝֟֝֝ <u>֚</u>	- US	2004013	2004071	11	Coating for optical MEM	359/223	359/224	N	Miller, Seth A. et al	Γ	г	г	г	ГГ
13	Þ	1	- US	2004010	2004052	35	Spatial light modulators	359/291		F	Huibers, Andrew G.	Г	г	Г	Г	гг,
14	F.	1	- US	2004010	2004052	38	Spatial light modulators	359/290		F	Huibers, Andrew G.	г.	Г,	г	г	Г,Г
15	F	Ī	- US	2004010	2004052	38	Spatial light modulators	349/25		F	luibers, Andrew G.	Г	, г	Г	г	ריָר
16	P	ŗ	- US	2004001	2004012	38	Spatial light modulators	359/291		ŀ	Huibers, Andrew G.	٦	· r	Г	г	r r
17	P	ſ	- US	2004000	2004011	20	Direct, low frequency cap	324/683		P	Pelz, Jonathan P. et	Г	г	7	г	ГГ
18	Þ	1	- US	2003012	2003071	13	Method and apparatus fo	438/48		F	Robbins, Roger A.	Г	Г	г	Г	г <u>г</u>
19	P	1	US	2003010	2003060		MINIATURE RECIPRO	62/6	60/520;	Ţ	Thiesen, Jack H. et	Г.	: Г.	г	г	ГГ
20	Þ	ļ	- US	2003006	2003040	7	Methods of applying coat	427/126.3	118/300;	N	Miller, Seth A.	۲	Г	٦	Г	г г
21	₽	1	- US	2003005	2003032	27	Methods for depositing, r	438/107		P	Patel, Satyadev R. e	٦	г.	г	r	гг
22	₽	ļ	- US	2003001	2003012	11	MEMS device with contr	355/53		Ī	Duncan, Walter M.	Г	г	г	г	r r .
23	F	ļ	- US	2003000	2003010	14	Lubricating micro-machin	353/119		N	Miller, Seth	г	· r	٦	г	гг
24	Þ	ļr	- US	2003000	2003010	8	Masking layer in substrat	174/256	174/52.4;	Ĺ	iu, Jwei Wien et al	г Г	Г	٦	Г	Г.Г
25	P	ı	- US	2002014	2002101	1	Miniature reciprocating h	62/6	60/520;	ī	hiesen, Jack H. et	۲	Г		г	г г :
3 Hds (C));	ſ	A HTM	20 12070 220	V TO PARTY		The summer of the second summer of						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			<u> </u>



	τ	j	ฎ	1	Do	cu	me	ent l	I	ssu	ıe I	Dat	Page	Title	Current O	Current X	Retrieval	Inventor	S	С	P	2	3 -
21	P	•	· F	- 1	US	20	003	3005	5 2	00	303	32	27	Methods for depositing, r	438/107			Patel, Satyadev R. e	г	Г	Г	г	רר
22		:	: r		ÜS	20	003	3001	2	00	30	12	11	MEMS device with contr	355/53			Duncan, Walter M.	٢		Г	г	ГГ
23	Þ		r	- ;	ÜS	20	003	000) 2	00	30	10	14	Lubricating micro-machin	353/119			Miller, Seth	г	Г	Г	г	ГГ
24	F		, r	- ;	US	20	003	3000	2	00	30	10	8	Masking layer in substrat	174/256	174/52.4;		Liu, Jwei Wien et al	٦	Ē	-	г	гг
25	F		ī	- !	ÜS	20	002	2014	1/2	00	210	01		Miniature reciprocating h	62/6	60/520;		Thiesen, Jack H. et	r	'n	r	г	רור
26	P		֡֡֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֓֡֡֡֓֓֡֡֡֡֝ ֡	- *; ;	ÜŚ	20	002	2008	3,2	00	20	70	10	Diluent assisted lubricati	427/58	427/421.1;		Jacobs, Simon Josh	г	. Г	_	г	ГГ
27	P		-	- ;	US	20	002	2006	5 2	00	20:	53	18	Micromechanical getter a	257/682	257/E23.0		Robbins, Roger A. e	Г		r	г	ГГ
28	P	Ì	Г	- ;	US	69	909	300) 2	00	500	52	9	Method for fabricating mi	324/761	324/754;		Lu; Nai-Cheng et al	Г	· Γ	Г	г	ГГ
29	Þ		C	- }	ŪŚ	69	900	5847	7 2	00	500	51	35	Spatial light modulators	359/291	359/224;		Huibers; Andrew G.	٦	Γ	г	г	ГГ
30	P		}	- }	ÜS	68	376	5071	1 2	00	504	10	6	Masking layer in substrat	257/678	257/701;		Liu; Jwei Wien et al	٦	Г	Г	г	ГГ
31	Þ	. !	[-	. (ÜŠ	68	356	5145	5/2	00	50:	21	19	Direct, low frequency cap	324/663	324/658		Pelz; Jonathan P. et	٦	; r	Г	г	гг
32	P		ľ	- ;	ÜS	68	344	959	2	00	50	l 1	34	Spatial light modulators	359/297	345/109;		Huibers; Andrew G.		F	Г	г	гг
33	F	1	-		ÜS	68	344	623	3 2	00	50	11	11	Temporary coatings for p	257/723	257/682;		Peterson; Kenneth	٢	; r	٢	г	гг
34	P		_		US	68	34]	079	2	00	50	11	18	Fluorochemical treatment	216/2	216/11;	artines is approved to a pathones to	Dunbar; Timothy D.	٣	, ,	r	г	гг
35	P	1	-	- 4	ÜŜ	68	300	5993	3 2	00	410	01	9	Method for lubricating M	359/291	359/290;		Adams; Lea et al.	٦	, r	-	г	гг
1] 3 H61 €)	+		(F		TW			7 - 3 -									h			•			<u> </u>